

(地域共同テクノセンター)

機器名	製造元・形式	主な用途	購入年
パルス管冷凍機		測定用試料の冷却	平成 10年
マイクロ波有機合成実験装置	東京電子	マイクロ波を用いた加熱反応	平成 15年
構造物疲労試験機	島津製作所	繰り返し载荷試験	昭和 57年
高周波マグネトロンスパッタリング装置	日本電子 JEC-SP360R	薄膜の作製	平成 8 年
真空蒸着装置	真空機工 VPC-410	金属膜の作製	平成 9 年
半導体評価装置(高分解能分光器、励起光源ロックイン増幅器)		半導体の表面状態の解析、半導体材料の特性解析	平成 7 年
FA 教育システム	ファナック	自動倉庫セル～組立検査セルまでのオペレーションシステム、教育訓練用	平成 11年
パルス管冷凍機		測定用試料の冷却	平成 10年
紫外可視近赤外分光光度計	日本分光 Ubest V-570	薄膜、液体等の光透過率や反射率の測定	平成 9 年
半導体評価装置(高分解能分光器、励起光源ロックイン増幅器)		半導体の表面状態の解析、半導体材料の特性解析	平成 7 年
放電加工機	シャルミー エレローダ 110 型	金属の放電加工	昭和 60年
恒温大型インキュベータ	サンヨー	微生物等の大量培養	平成 5 年

(専攻科・ものづくりセンター・情報処理教育センター)

機器名	製造元・形式	主な用途	購入年
ICP発光分光分析装置	SII ナテクノロジー(株)卓上型	水・溶液の重金属などの分析	平成 16 年
全有機炭素測定装置	島津 TOC-VCPH	水・溶液の有機炭素の分析	平成 15 年
CNC 旋盤	日立精機	精密部品製作	平成 6 年
マシニングセンタ	森精機	精密部品製作	平成 21 年
ワイヤカット放電加工機	ファナック WO	精密部品製作	平成元年
産業用ロボット(6 軸)	MELFA RV-M1	組立、移載、教育、研究用	平成 5 年
高速並列計算機	UNIX Alpha Station Tru64	分子軌道計算、熱流体計算、電磁界計算など	平成 12 年